

**SKRIPSI**  
**PENGEMBANGAN ALAT OKSIGEN**  
**KONSENTRATOR MENGGUNAKAN METODE**  
***PRESSURE SWING ADSORPTION* TAMPIL LCD**  
**TFT**  
**(Analisa Pengaruh Beda Laju Aliran Terhadap**  
**Konsentrasi Oksigen)**



**MUHAMMAD UAIS AVIE MA'LUF**  
**P27838120071**

**PROGRAM STUDI**  
**TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS**  
**PROGRAM SARJANA TERAPAN**  
**JURUSAN TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS**  
**POLTEKES KEMENKES SURABAYA**  
**TAHUN 2024**



**PENGEMBANGAN ALAT OKSIGEN  
KONSENTRATOR MENGGUNAKAN METODE  
*PRESSURE SWING ADSORPTION* TAMPIL LCD  
TFT**

**(Analisa Pengaruh Beda Laju Aliran Terhadap  
Konsentrasi Oksigen)**

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan  
dalam memperoleh sebutan Sarjana Terapan Teknik  
pada Program Studi Teknologi Rekayasa  
Elektromedis**

**SKRIPSI**



**MUHAMMAD UAIS AVIE MA'LUF  
P27838120071**

**PROGRAM STUDI  
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
JURUSAN TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS  
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA  
TAHUN 2024**

**LEMBAR PERNYATAAN GELAR**  
**PENGEMBANGAN ALAT OKSIGEN**  
**KONSENTRATOR MENGGUNAKAN METODE**  
***PRESSURE SWING ADSORPTION* TAMPIL LCD**  
**TFT**  
**(Analisa Pengaruh Beda Laju Aliran Terhadap**  
**Konsentrasi Oksigen)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh sebutan Sarjana Terapan Teknik**  
**Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedis**  
**Program Sarjana Terapan**  
**Jurusan Teknologi Elektromedis**  
**Poltekkes Kemenkes Surabaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD UAIS AVIE MA'LUF**  
**P27838120071**

**PROGRAM STUDI**  
**TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS**  
**PROGRAM SARJANA TERAPAN**  
**JURUSAN TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS**  
**POLTEKKES KEMENKES SURABAYA**  
**TAHUN 2024**